

※課題番号 : F-12-KT-0121
※支援課題名 (日本語) : MEMS センサの開発
※Program Title (in English) : Development of MEMS sensor
※利用者名 (日本語) : 椎木 正和
※Username (in English) : Masakazu Shiinoki
※所属名 (日本語) : オムロン株式会社 マイクロデバイス事業部
※Affiliation (in English) : Micro Devices Division, OMRON Corporation

※概要 (Summary) :

【相談内容】

微少物体を検出可能な MEMS センサを開発するための初期課題となる、物体濃度と出力の関係、SNR 特性を把握し、デバイスの開発仕様を明確にしたい。

希望利用装置

- ・真空蒸着装置
- ・多元スパッタ装置等

【回答】

利用目的には真空蒸着装置で対応が可能と思われる。

【結果】 H24 年度自主事業として利用

※実験 (Experimental) :

技術相談のため割愛

※結果と考察 (Results and Discussion) :

技術相談のため割愛

※その他・特記事項 (Others) :

なし